

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第6部門第4区分  
【発行日】平成17年6月9日(2005.6.9)

【公開番号】特開2004-342210(P2004-342210A)

【公開日】平成16年12月2日(2004.12.2)

【年通号数】公開・登録公報2004-047

【出願番号】特願2003-136697(P2003-136697)

【国際特許分類第7版】

G 1 1 B 5/31

【F I】

G 1 1 B 5/31 C

【手続補正書】

【提出日】平成16年8月20日(2004.8.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 4 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 4 1】

また、請求項15記載の垂直磁気記録用磁気ヘッドの製造方法では、第2層を形成する工程は、第1層の上に、第2層を形成するための被パターニング層を形成する工程と、被パターニング層の上に、被パターニング層をパターニングするためのエッチングマスクを形成する工程と、エッチングマスクを用いて、被パターニング層および第1層を選択的にエッチングする工程とを含んでいる。そして、エッチングする工程において、被パターニング層がパターニングされることによって第2層が形成され、且つ第1層がパターニングされる。本発明によれば、第1層と第2層との位置合わせを正確に行うことができ、その結果、良好な記録特性を実現することができるという効果を奏する。